

真空 VACUUM Technology for innovation 2024展

招待状

基調講演

18日	(国研) 航空宇宙研究開発機構 理事 / 宇宙科学研究所 所長	國中 均 氏
19日	オムティア(インフォーマイテリジェンス) シニアコンサルティングディレクター	南川 明 氏

同時開催 光学薄膜研究会セミナー 主催：光学薄膜研究会

リアル 【入場料】1,000円(入場登録者、招待状持参者、中学生以下は無料)

会期 2024年9月18日(水)～20日(金) 10:00～17:00

会場 東京ビッグサイト 東ホール

オンライン 【入場料】無料(登録制)

会期 2024年9月11日(水)～27日(金)

主催：(一社)日本真空工業会、(公社)日本表面真空学会、日刊工業新聞社
後援：経済産業省、文部科学省、(独)日本貿易振興機構 [一部申請中]

<https://biz.nikkan.co.jp/eve/vacuum/>

9/20(金)

⑨規格標準報告会

定員：100名
10:30～12:10
(受付10:00～)

参加費
無料

ガス放出と真空技術の国際規格動向

日本表面真空学会(JVSS)と日本真空工業会(JVIA)は、「規格標準合同検討委員会」を組織して真空技術に関するJISやISO規格の提案・検討を協力して行っております。

気体放出は真空装置にとって到達圧力を制限し、目標圧力までの到達時間を長くする主な要因であることはよく知られています。より高い真空度を得るためには、真空容器や内部の部品は、より気体放出の少ない材料を選択することが重要になります。そこで今年は特別講演として、(株)アルバックの稲吉 さかえ様をお招きして、各種材料や表面処理の違いによる気体放出特性についてわかりやすくご講演いただきます。また、規格標準合同検討委員会の取り組みとして、ターボ分子ポンプの性能試験方法のISO規格の見直しや、真空フランジのJIS改正など最近の真空技術に関するISO・JIS制改定状況について報告いたします。

■場所：東5ホール内 セミナー会場B

講座内容

- | | |
|---|--|
| 1. 「各種材料及び表面処理の気体放出特性」
(株)アルバック 先進技術研究所 稲吉 さかえ 氏 | 3. 「真空フランジの規格」
(国研)産業技術総合研究所 吉田 肇 氏 |
| 2. 「ターボ分子ポンプの性能測定規格
～排気速度、圧縮比、到達圧力 これらの関係～」
(株)島津製作所 芦田 修 氏 | 4. 「規格標準合同検討委員会活動報告
～最近のISO・JISの制改定等について～」
(株)フジ・テクノロジー 鈴木 明 氏 |

規格標準報告会

テーマ：核融合と真空技術の国際規格動向

日本表面真空学会（JVSS）と日本真空工業会（JVIA）は、「規格標準合同検討委員会」を組織して真空技術に関するJIS規格やISO規格の提案・検討を協力して行っております。

主要エネルギー源である化石燃料や再生可能エネルギーに次ぐ次世代エネルギーであり、安全性が高くカーボンニュートラルの実現として期待される「核融合発電」に向けた国際的なプロジェクト「ITER」が進行中です。そこで特別講演として、量子科学技術研究開発機構の柏木 美恵子様をお招きして、ITER計画の状況や今後の展開についてご講演いただきます。

また、規格標準合同検討委員会の取組として審議を行った真空ポンプ用語のJIS規格やNEGポンプ、クライオポンプのISO規格及び、今年の6月に実施されたISO/TC112真空技術の国際会議報告など最近の真空技術に関するISO・JIS制改定状況について報告いたします。

日時：2023年 12月 1日（金） 10:30 ～ 12:10

場所：東京ビックサイト 西ホール展示会場内 出展者セミナー会場

主催：公益社団法人日本表面真空学会 規格標準化委員会/一般社団法人日本真空工業会 規格標準委員会

参加費：無料

講演内容：

1. 「ITER NBI の真空技術 高電圧絶縁とトリチウム境界」

～核融合発電に向けた品質保証の確立に向けて～

柏木 美恵子（国立研究開発法人 量子科学技術研究開発機構 量子エネルギー部門 那珂研究所）

2. 「TC112 国際会議報告及び、クライオポンプの性能試験方法 / NEG ポンプの性能試験方法」

谷津 貴裕（住友重機械工業株式会社）

吉田 肇（国立研究開発法人 産業技術総合研究所）

3. 「JIS Z 8126-2 真空ポンプ及び関連用語 改定」

田中 敬二（株式会社荏原製作所）

4. 「規格標準合同検討委員会活動報告」

～最近の ISO・JIS の制改定等について～

神田 浩二（キヤノンアネルバ株式会社）

規格標準報告会

日本の半導体と真空技術の国際規格動向

日本表面真空学会（JVSS）と日本真空工業会（JVIA）は、「規格標準合同検討委員会」を組織して真空技術に関するJISやISO規格の提案・検討を協力して行っています。

日本の半導体産業については、新型コロナウイルス対応によるデジタル化の進展、カーボンニュートラルに向けた動き、世界的な半導体需給状況のひっ迫、先端技術を取り巻く貿易問題など、取り巻く環境は大きく変化しています。

そこで今年は、経済産業省製造産業局産業機械課の池田様をお招きして、日本の半導体政策の動向についてご講演いただくとともに、産業技術総合研究所 TIA 推進センター 林様をお招きして、先端半導体製造技術コンソーシアムの現状についてご講演いただきます。

また、規格標準合同検討委員会の取組として、審議を行ったナIFEッジフランジのJIS規格や真空装置用図記号、及び最近の真空技術に関するISO・JIS制改定状況について報告いたします。

日時：2022年 10月 20日（木） 10:10 ～ 12:10

場所：東京ビックサイト 西ホール展示会場内 出展者セミナー会場

主催：公益社団法人日本表面真空学会 規格標準化委員会/一般社団法人日本真空工業会 規格標準委員会

参加費：無料 事前申込制

項目	講演時間
1. 「日本の半導体政策の動向について」 池田 秀俊（経済産業省製造産業局産業機械課）	30 分
2. 「先端ロジック半導体技術トレンドとその製造プロセス技術」 ～3次元化構造化へのパラダイムシフト～ 林 喜宏（（国）産業技術総合研究所 TIA 推進センター 戦略連携ユニット）	40 分
3. 「JIS B 2294 ナIFEッジフランジの形状及び寸法の制定」 ～超高/高真空用メタルフランジの JIS 規格化～ 新井 健太（（国）産業技術総合研究所）	15 分
4. 「真空装置用図記号の ISO 規格と JIS の開発」 吉田 肇（（国）産業技術総合研究所）	15 分
5. 「規格標準合同検討委員会活動報告」 ～最近のISO・JISの制改定等について～ 神田 浩二（キヤノンアネルバ㈱）	15 分

規格標準報告会

クライオポンピングと、真空技術に関する国際規格の動向について

日本表面真空学会（JVSS）と日本真空工業会（JVIA）は、「規格標準合同検討委員会」を組織して真空技術に関するJISやISO規格の提案・検討を協力して行なっています。

クライオポンプは排気速度が大きく、クリーンな真空が実現できるため、半導体製造装置や超高真空装置などで広く利用されています。今年は、学習院大学の荒川先生をお招きして、低温表面における気体分子の挙動についてご解説いただきます。

また合同検討委員会の取り組みとして、審議中のクライオポンプや高安定電離真空計のISO規格の開発状況など、真空技術に関するISO・JIS制改定状況について報告します。

日時：2021年 12月 3日（金） 10:10 ～ 12:10

場所：東京ビックサイト 西ホール展示会場内 出展者セミナー会場

主催：公益社団法人日本表面真空学会 規格標準化委員会/一般社団法人日本真空工業会 規格標準委員会

参加費：無料 事前申込制

項目	講演時間
1. クライオポンピング ～原理は単純なのだが・・・～ 荒川 一郎（学習院大学理学部）	50分
2. クライオポンプのISO規格開発の状況 谷津 貴裕（住友重機械工業株式会社）	40分
3. 高安定電離真空計のISO規格開発の状況 ～欧州プロジェクト(EMPIR)の成果～ 吉田 肇（(国)産業技術総合研究所）	15分
4. 規格標準合同検討委員会活動報告 ～最近のISO・JISの制改定等について～ 吉川 康秀（アズビル株式会社）	15分